



Torino, 30 settembre 2019

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 - CUP E15D18000350007 - CUI F00518460019201900102

Convocazione III Seduta pubblica

Si comunica che il giorno **07 ottobre 2019 alle ore 10:30 presso la Sala CdA del Rettorato**, sita al primo piano dell'Ateneo in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, si terrà la terza seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto, nel corso della quale si procederà all'apertura delle Buste "B" contenenti la documentazione tecnica e alla ricognizione pubblica del loro contenuto.

Ufficio Appalti